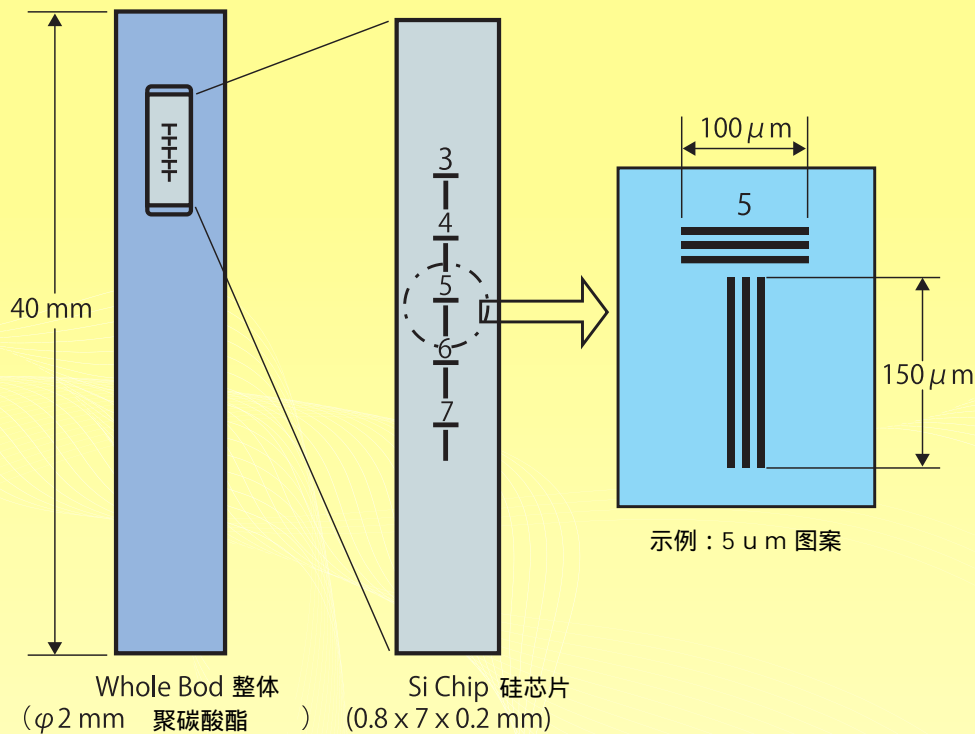
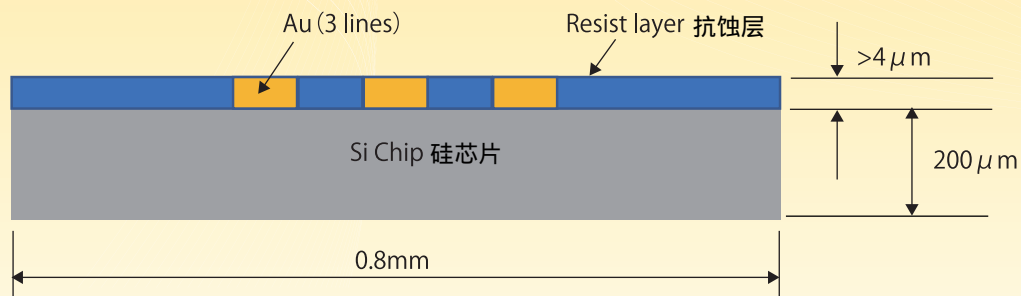


采用最先进的半导体工艺技术，采用金 (Au) 吸收材料开发了一种新的 CT 分辨率图，适用于从 3 微米到 7 微米的 5 种不同尺寸的线和空间。这是检查 Microfocus X 射线 CT 扫描系统性能的非常有用且不可或缺的工具，也可用于校准、设置、维护、日常对准等。

Layout 结构布局



Cross section of the Chip 芯片横截面



※The order form can be downloaded from
JIMA Website.

(一社) 日本検査機器工業会

Japan Inspection Instruments Manufacturers' Association



Case 包装



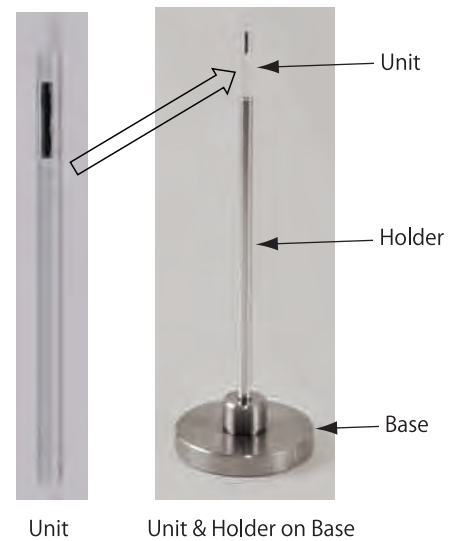
Kit 套件



Specification 规格

元件	聚碳酸酯	$\phi 2 \times 40\text{mm}$
	硅芯片	$0.8 \times 7 \times 0.2\text{mm}$
	吸波材料	Au: Thickness $>4\mu\text{m}$
	线数	3 Lines each size (T Shape)
	线宽和空间宽	$3, 4, 5, 6, 7\mu\text{m}$
	宽度公差	$\pm 15\% (3, 4\mu\text{m}) \pm 10\% (>5\mu\text{m})$
支架	不锈钢	$\phi 3 \times 120\text{mm}$
底座	不锈钢	$\phi 49.5 \times 19\text{mm}$
	工作温度	$10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Assembly(Example) 组装示例



Order / Contact